LIQUID CRYSTAL INJECTION METHOD AND LIQUID DISPENSER

Publication number:

JP10142616

Publication date:

1998-05-29

Inventor:

ABE HIDEYUKI; OSHIMA NOBUMASA

Applicant:

AYUMI INDUSTRY

Classification:

- international:

G02F1/1341; G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/1341

- European:

Application number:

JP19960320800 19961114

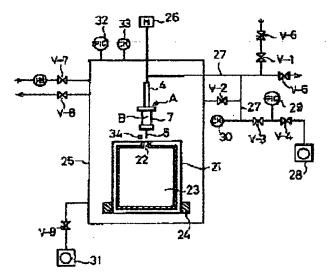
Priority number(s):

JP19960320800 19961114

Report a data error here

Abstract of JP10142616

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal injecting method by which liquid crystal can be injected into a liquid crystal cell with little loss in a short time, and to provide a pressure dropping type liquid dispenser based on inert gas introduction by which liquid crystal can be injected with high precision in a vacuumed atmosphere, in an atmospheric pressure atmosphere or in a pressurized atmosphere. SOLUTION: A liquid crystal cell 21, in which an injection port 22 for injecting liquid crystal B is arranged on the upper side, is held in a vacuum chamber 25 under a vacuumed atmosphere. Using a liquid dispenser A which is arranged in the vacuum chamber 25 and can drop a predetermined quantity of liquid crystal B in a controlled condition, inert gas is fed into a dispenser main body 1 from an inert gas introducing tube 4 arranged above the liquid dispenser A while a pressure condition inside the vacuum chamber 25 and a pressure condition inside the liquid dispenser A are regulated, so that the inside of the liquid dispenser A is pressurized and the liquid crystal B charged in a liquid sump part 7 is injected by a predetermined quantity into a liquid crystal injection part 23 in the liquid crystal cell 21.



-- -- -- -- -- (19)日本国特許庁(J-P)--- -- (12) **公 - 開 特 - 許 - 公 - 報** (A) - -- (11)特許出願公開番号

特開平10-142616

(43)公開日 平成10年(1998) 5月29日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

G02F 1/1341

G02F 1/1341

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平8-320800

(22)出廣日

平成8年(1996)11月14日

(71)出願人 392012951

アユミ工業株式会社

兵庫県姫路市花田町加納原田101

(72)発明者 阿部 英之

兵庫県姫路市花田町加納原田101 アユミ

工業株式会社内

(72)発明者 大島 信正

大阪府枚方市宮之阪3丁目19-5

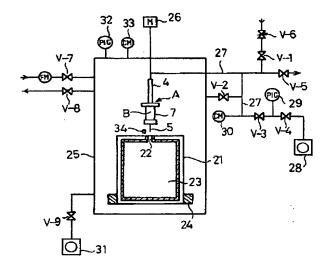
(74)代理人 弁理士 田中 浩 (外2名)

(54) 【発明の名称】 液晶注入方法および液体用ディスペンサー

(57)【要約】

液晶のロスを少なくして、かつ短時間で液晶 セル内に液晶を注入する方法および減圧雰囲気、大気圧 雰囲気あるいは加圧雰囲気下で高精度の液晶注入が可能 な不活性ガス導入による加圧滴下式の液体用ディスペン サーを提供する。

【解決手段】 液晶Bを注入するための注入口22を上 方に設けた液晶セル21を減圧雰囲気下の真空室25内 に保持し、この真空室25内に配置され、所定量の液晶 Bを制御された状態で滴下することが可能な液体用ディ スペンサーAを用いて、上記真空室25内の圧力状態と 液体用ディスペンサーA内の圧力状態とを調整しつつこ の液体用ディスペンサーAの上方に設けられている不活 性ガス導入管4からディスペンサー本体1内に不活性ガ スを送り込むことにより液体用ディスペンサーA内を加 圧して液溜め部7に充填されている液晶Bを上記注入口 22から液晶セル21の液晶注入部23に所定量注入す る。



【特許請求の範囲】

、【請求項1】 液晶を注入するための少なくとも1個の注入口を設けるように2枚の液晶基板の端部をシール剤で封止して液晶注入部を形成した液晶セルを、その注入口を上に向けた状態で減圧雰囲気下の真空室内に保持したのち、この真空室内に配置された液晶を充填し、その内部を減圧、大気圧、加圧などの任意の圧力状態に調節する機構を具備し、下部に液晶滴下用細管を有する液体用ディスペンサーを用いて、大気圧またはそれ以上の雰囲気下で上記注入口から所定量の液晶を上記液晶注入部 10に注入することを特徴とする液晶注入方法。

【請求項2】 液晶を注入するための注入口を上下に少なくとも1個ずつ設けるように2枚の液晶基板の端部をシール剤で封止して液晶注入部を形成した液晶セルを、滅圧雰囲気下の真空室内に保持したのち、上方の注入口からはこの真空室に配置された液晶を充填し、その内部を滅圧、大気圧、加圧などの任意の圧力状態に調節する機構を具備し、下部に液晶滴下用細管を有する液体用ディスペンサーによる滴下法にて、下方の注入口からは間に含く真空室に配置した液晶を充填した液晶皿又は液晶を充っためのディスペンサーを連結した液晶皿又は液晶を接触させる接触法にて、大気圧またはそれ以上の雰囲気下で上、下の注入口から同時に所定量の液晶を上記液晶注入ずることを特徴とする液晶注入方法。

【請求項3】 2枚の液晶基板の上下に少なくとも1個 ずつの注入口を設けるように端部をシール剤で封止して 液晶注入部を形成した液晶セルと、液晶を充填し、その 内部を減圧、大気圧、加圧などの任意の圧力状態に調節 する機構を具備し、下部に液晶滴下用細管を有する液体 用ディスペンサーと、液晶を充填した液晶皿又は液晶補 充のためのディスペンサーを連結した液晶皿とをそれぞ れゲートバルブで連結された別個の真空室に配置し、各 真空室内を減圧したのち、上記ゲートバルブを開口して 上記液体用ディスペンサーと液晶を充填した液晶皿を上 記液晶セルが配置されている真空室内に移動させるとと もに、その昇降によって上記液晶セルの注入口に接触さ せ、次いで真空室を大気圧にするに伴って上方の注入口 からは大気圧またはそれ以上の雰囲気下で所定量の液晶 を制御された状態で放出させることの可能な上記液体用 ディスペンサーによる滴下法にて、また上記下方の注入 口からは上記液晶皿中の液晶を接触法にて、上下注入口 から同時に液晶を注入することを特徴とする液晶注入方

【請求項4】 放出する液体を溜める液溜め部とこの液溜め部の下方を細管状とした送出部とからなるディスペンサー本体と、このディスペンサー本体を密閉する上下のキャップとからなり、上記ディスペンサー本体の上部に接着されるキャップには上記ディスペンサー本体の上部に連通する不活性ガス導入管を設け、下部に嵌着するキャップには上記ディスペンサー本体下方の細管状送出

部に接続可能な液体注出用細管を設けるとともに、この …… ディスペンサー内部を真空排気する機構、ディスペンサーを収容する真空室内の圧力とディスペンサー内部の圧力とを同圧にする機構、さらには上記不活性ガス導入管に接続してディスペンサー内部を不活性ガスで加圧できる機構とを有していて、上記液溜め部に充填した液晶の定量を上記液体注出用細管から滴下することを特徴とする液体用ディスペンサー。

【請求項5】 液体抽出用細管の先端を複数個の分岐管 としたことを特徴とする請求項4記載の液体用ディスペンサー。

【請求項6】 液体抽出用細管の先端に液晶セルの注入口の幅と同等またはそれ以上の幅を以て液晶を滴下できる多孔底面あるいは網状底面を呈するガイド部を設けたことを特徴とする請求項4記載の液体用ディスペンサー。

【請求項7】 液体抽出用細管の先端に液晶セルの注入口の幅と同等またはそれ以上の幅を以て液晶を滴下できる多孔底面あるいは網状底面を呈する原状扁平管を設けたことを特徴とする請求項4記載の液体用ディスペンサー

【請求項8】 液体用ディスペンサーは減圧下、不活性 ガス導入によるガス加圧により液溜め部の液晶を滴下す るに際し、液晶セルの注入口とディスペンサー先端の細 管との中間位置に設置された光センサーでその滴下量を 制御することによって液晶注入部に所定量の液晶を注入 できるようにしたことを特徴とする請求項4記載の液体 用ディスペンサー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶ディスプレイの製造工程における液晶セルへの液晶の注入方法およびこの液晶注入を効率よく実施することのできる液体用ディスペンサーに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、液晶セルへの液晶の注入方法は、バターン状透明電極、カラーフィルター、配向膜などの機能層を形成した2枚のガラス基板の一辺上に少なくとも1個の液晶注入用の注入口を設けるようにシール樹脂で固着して得た液晶セルを、液晶を充填した液晶皿を設置した真空容器内に入れて減圧状態にしたのち、液晶セルの注入口に液晶を接触させ、容器内を大気圧に戻すとによって毛細管現象と液晶セルの内と外との圧力を利用して液晶を注入する方法が主として行われている。【0003】液晶を液晶セルの注入口に接触させる方法をとしては、図12(a)のように液晶65を充填した液晶皿66に液晶セル61の下向きの注入口62を浸漬法や、図12(b)のように液晶皿66に紐状体67を設けて、液晶セル端面全体を液晶皿に浸けることなしに注入口62のみをこの紐状体67に接触させて液晶注入を

50

3

行うヤーン法などが接触方式として広く実用化されてい、ニュ注入の初期段階で注入口に対する滴下量不足で液晶セル。

【0004】しかし、上記の浸漬法の場合、液晶注入時 に液晶セル61の注入口62だけでなく、液晶セル端面 全体が液晶65に浸漬されるため、液晶セル端面にも液 晶が付着して高価な液晶のロスが多く、また上記のよう に液晶セル端面に接触し、汚染されて液晶の特性が低下 するという問題がある。

【0005】また、後者のヤーン法の場合は、液晶注入 口が液晶を浸透した紐状体と接触するだけなので、浸漬 10 法に比べると液晶のロスや汚染は少ないが、液晶皿の構 造が複雑になるという問題がある。

【0006】上記の接触法における問題を解決する方法 として、図12 (c) のように液晶セル61の注入口6 2を上向きとし、その上方から液晶 6 5 を液体用ディス ペンサー68によって注入口62に滴下する方法も行わ れている。しかし、従来の液体用ディスペンサーは、そ の先端の細管から大気圧中で液体を定量吐出させるタイ プのものが殆どであり、このようなディスペンサーを減 圧雰囲気中で使用すると、ディスペンサー内部に気泡が 20 生じて液体の吐出が難しいという問題がある。このよう なことから、本出願人は真空中で液晶を定量滴下するこ とのできる液体用ディスペンサーを提案した(特開平5 -346561号)。

【0007】液体用ディスペンサーによる滴下法で多数 枚の液晶セルを同時に処理をするためには、ディスペン サー1本あたり単位時間に滴下させる滴数に制限がある ため、小型の液晶セルに液晶を注入する場合にしか使用 できなかった。また、大型セルに液晶を注入する場合、 ディスペンサー1本当りで注入できるセルの処理枚数が 30 少なくなり、多数枚同時に注入を行おうとする場合に は、ディスペンサーを多数個液晶注入装置に取り付けな ければならない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記提案し た液体用ディスペンサーは、構造が複雑であり、また真 空用ステッピングモーターおよびそれを制御するための モーターコントローラーを使用していることから製造コ ストが高くなり、大型セルに液晶を注入する装置に多数 個このようなディスペンサーを取り付けることは実用上 40 極めて困難である。

【0009】また、最近は液晶セルサイズが大型化し、 しかも液晶が注入されるセル間隙が小さくなりつつある 現状において、上記したこれまでの接触方式あるいは滴 下方式の液晶注入では長時間を要することから液晶の注 入工程が液晶セルの生産性向上の障害の1つとなってい る。また、液晶注入に長時間を要する問題の1つの対策 として、液晶セルの注入口を従来より広くしようとする 傾向がある。この場合、ディスペンサーの先端が単なる 注射針のような細管で一滴ずつ滴下する方法では、特に 50 中に気泡が発生する恐れがある。

【0010】この発明は、上記の問題点に鑑み、大型セ ルあるいはセル間隙の小さい液晶セルに液晶を注入する 場合においても上下の注入口から同時に注入できて注入 時間の短縮をはかることのできる液晶注入方法を提供す ること、そして上方の注入口からの滴下法において、従 来のピストン方式の液体用ディスペンサーに代えて、加 圧可能な耐圧構造で、窒素等の不活性ガスを用いた加圧 滴下方式とすることによって取り扱いが容易で、低コス トで実用性の高い液体用ディスペンサーを提供するこ と、また液体用ディスペンサーの先端を複数の分岐状細 管としたり、液晶セルの注入口の幅と同等以上の幅に滴 下可能なように液体用ディスペンサーの先端細管に多孔 底面または網状底面を呈するガイド部を設けることで、 大型あるいはセル間隙の小さい液晶セルあるいは幅の広 い注入口や複数の注入口が設けられている液晶セルに対 しても、数少ないディスペンサーで短い時間で安定した 液晶注入を可能とすることを目的とするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】即ち、この発明のうち請 求項1記載の発明は、液晶を注入するための少なくとも 1個の注入口を設けるように2枚の液晶基板の端部をシ ール剤で封止して液晶注入部を形成した液晶セルを、そ の注入口を上に向けた状態で減圧雰囲気下の真空室内に 保持したのち、この真空室内に配置された液晶を充填 し、その内部を減圧、大気圧、加圧などの任意の圧力状 態に調節する機構を具備し、下部に液晶滴下用細管を有 する液体用ディスペンサーを用いて、大気圧またはそれ 以上の雰囲気下で上記注入口から所定量の液晶を上記液 晶注入部に注入することを特徴とする液晶注入方法であ

【0012】請求項2記載の液晶注入方法は、液晶を注 入するための注入口を上下に少なくとも1個ずつ設ける ように2枚の液晶基板の端部をシール剤で封止して液晶 注入部を形成した液晶セルを、減圧雰囲気下の真空室内 に保持したのち、上方の注入口からはこの真空室に配置 された液晶を充填し、その内部を減圧、大気圧、加圧な どの任意の圧力状態に調節する機構を具備し、下部に液 晶滴下用細管を有する液体用ディスペンサーによる滴下 法にて、下方の注入口からは同じく真空室に配置した液 晶を充填した液晶皿又は液晶補充のためのディスペンサ ーを連結した液晶皿に注入口を接触させる接触法にて、 大気圧またはそれ以上の雰囲気下で上、下の注入口から 同時に所定量の液晶を上記液晶注入部に注入することを 特徴とするものである。

【0013】また、請求項3記載の液晶注入方法は、2 枚の液晶基板の上下に少なくとも1個ずつの注入口を設 けるように端部をシール剤で封止して液晶注入部を形成 した液晶セルと、液晶を充填し、その内部を減圧、大気

圧、加圧などの任意の圧力状態に調節する機構を具備や、1個の液晶土ルで複数個の注入口を有する場合にお し、下部に液晶滴下用細管を有する液体用ディスペンサ ーと、液晶を充填した液晶皿又は液晶補充のためのディ スペンサーを連結した液晶皿とをそれぞれゲートバルブ で連結された別個の真空室に配置し、各真空室内を滅圧 したのち、上記ゲートバルプを開口して上記液体用ディ スペンサーと液晶を充填した液晶皿を上記液晶セルが配 置されている真空室内に移動させるとともに、その昇降 によって上記液晶セルの注入口に接触させ、次いで真空 室を大気圧にするに伴って上方の注入口からは大気圧ま たはそれ以上の雰囲気下で所定量の液晶を制御された状 態で放出させることの可能な上記液体用ディスペンサー による滴下法にて、また上記下方の注入口からは上記液 晶皿中の液晶を接触法にて、上下注入口から同時に液晶 を注入することを特徴とするものである。

【0014】請求項4記載の発明は、放出する液体を溜 める液溜め部とこの液溜め部の下方を細管状とした送出 部とからなるディスペンサー本体と、このディスペンサ 一本体を密閉する上下のキャップとからなり、上記ディ スペンサー本体の上部に嵌着されるキャップには上記デ ィスペンサー本体の上部に連通する不活性ガス導入管を 設け、下部に嵌着するキャップには上記ディスペンサー 本体下方の細管状送出部に接続可能な液体注出用細管を 設けるとともに、このディスペンサー内部を真空排気す る機構、ディスペンサーを収容する真空室内の圧力とデ ィスペンサー内部の圧力とを同圧にする機構、さらには 上記不活性ガス導入管に接続してディスペンサー内部を 不活性ガスで加圧できる機構とを有していて、上記液溜 め部に充填した液晶の定量を上記液体注出用細管から滴 下することを特徴とする液体用ディスペンサーである。 【0015】また、請求項5は請求項4記載の液体用デ ィスペンサーにおいて、液体注出用細管の先端を複数個 の分岐管としたことを特徴とし、請求項6および7は請 求項4記載の液体用ディスペンサーにおいて、液体注出 用細管の先端に液晶セルの注入口の幅と同等またはそれ 以上の幅を以て液晶を滴下できる多孔底面あるいは網状 底面を呈するガイド部、あるいはそのような原状扁平管 を設けたことを特徴とするものである。そして、請求項 8は、請求項4記載の液体用ディスペンサーにおいて、 減圧下、不活性ガス導入によるガス加圧により液溜め部 の液晶を滴下するに際し、液晶セルの注入口とディスペ ンサー先端の細管との中間位置に設置された光センサー でその滴下量を制御することによって液晶注入部に所定 置の液晶を注入できるようにしたことを特徴とするもの である。

【0016】要するに、この発明はディスペンサー本体 内の液溜め部に充填した液晶を不活性ガスによる加圧に よって滴下する構造の液体用ディスペンサーとしたこと によって、簡単な操作で液晶注入ができ、また大型ある いはセル間隙の小さい液晶セルにおける幅の広い注入口 50 いても、液体用ディスペンサーの先端細管を分岐管とし たり、あるいは多孔または網状底面としたガイド部や扇 状扁平管を先端細管に取り付けることで、数少ないディ スペンサーで複数個の注入口に同時に安定した液晶注入 を行うことができるので、生産効率の向上、設備費の大 幅削減を可能とするものである。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、この発明を図に基づいて説 明する。まず、この発明になる液体用ディスペンサーか ら説明すると、図1が液体用ディスペンサーAの側面図 であり、図2はそれを構成する各部位の断面図である。 液体用ディスペンサーAは図から明らかなようにディス ペンサー本体1、上部キャップ2、下部キャップ3から なり、ディスペンサー本体1に上部キャップ2、下部キ ャップ3を嵌着することにより構成されている。そし て、4は上部キャップ2に嵌着されている不活性ガス導 入管であり、5は下部キャップ3の下方に細管固定部6 によって固着されていて液溜め部7の液晶を滴下する注 射針のような金属製の細管である。

【0018】このような構成の液体用ディスペンサーA を図2について詳しく説明すると、図2(b)のディス ペンサー本体1は内部を液溜め部7とする3フッ化エチ レン等の材質からなる加圧可能な耐圧構造の簡体を呈 し、その下部は漏斗のような先細の形状となっていて送 出部8を形成している。そして、上記箇体の上方と下方 の外周にネジ溝9、10が形成されており、また上部に は0リング11が嵌挿されている。

【0019】図2 (a) の上部キャップ2には上方に突 出するようにステンレス製の不活性ガス導入管4が上部 キャップ2の上面内側にその取付け部13で固着され、 またその側面内周側には上記したディスペンサー本体1 の简体の上方外周に形成したネジ溝9と嵌合するネジ溝 12が形成されている。そして、上記筒体上部の〇リン グ11が上部キャップ2の上面内側の取付け部13に当 たるまで上記両ネジ溝9と12を螺合することによって ディスペンサー本体 1 に上部キャップ 2 が嵌着される。 【0020】同様にして、下方中央部に細管5が固着さ れている図2(c)の下部キャップ3にもその側面内周 側にネジ溝14が形成されており、このネジ溝14と上 記したディスペンサー本体1の筒体の下方外周に形成さ れているネジ溝10とを螺合することによってディスペ ンサー本体1に下部キャップ3が嵌着される。このよう にして、この発明の液体用ディスペンサーAが得られ

【0021】このディスペンサーAの液溜め部への所要 量の液晶材料の充填は上部キャップ2をはずして行えば よい。しかし、必要ならばディスペンサー上方に充填用 注入管を取り付けたり、ガス導入管4を兼用することも 可能である。また、下方の注入口から液晶を注入する液

30

20

射針にて行われるが、請求項2および3に記載のように 真空室内に液晶皿への液晶補充用として液晶を充填した ディスペンサーを液晶皿に連結させておいてもよい。

【0022】次に、このようにして得られた液体用ディ スペンサーを用いてのこの発明の液晶注入方法を説明す る。図3はこの発明の液晶注入方法の一実施例を示す液 晶注入装置の概念図であり、図において21は2枚の基 板をシール剤で貼り合わせ、上面中央部に液晶注入口2 2を、内部に液晶注入部23を形成した液晶セルであ る。この液晶セル21は基板用カセット24に収納さ れ、真空室25内に固定配置されている。そして、この 液晶セル21の液晶注入口22に細管5が合致するよう にして液溜め部7に液晶Bを充填した液体用ディスペン サーAが若干の間隙を有するように配置され、上下動調 節モーター26に接続されていて、その上下動によって 液晶注入口22に接触させるようになっている。

【0023】また、液体用ディスペンサーAの不活性ガ ス導入管4には窒素ガスのような不活性ガスボンベ (図 示せず) および真空ポンプ28から配管27されてお り、この配管27の経路には種々のバルブが配置されて いる。即ち、V-1は不活性ガスボンベから不活性ガス 導入管4への不活性ガス導入バルブ、V-6はガス流量 調節バルブである。V-2は真空室25とディスペンサ -A内の圧力を同圧にする時の調節バルブ、V-3は予 備タンクバルブ、Vー4は予備タンク背圧バルブであ る。また、V-5はディスペンサーA内を大気圧に戻す ときに用いる大気開放調節バルブであり、29は真空度 測定用のピラニ真空計、30は圧力計である。

【0024】さらに、V-7およびV-8は真空室25 を大気圧に戻す時の不活性ガスの導入と排出を調節する バルブである。V-9は真空室25内を真空ポンプ31 で真空にする時の調節バルブであり、32、33は真空 室25に取り付けられているピラニ真空計と圧力計であ る。また、34は液晶セル21の液晶注入口22と液体 用ディスペンサーAの液晶注入用細管5との間に位置す るように設けられ、液晶滴下を制御するための光ファイ パーで直結された光センサーである。そして、このセン サー34と上記した各調節バルブとは図示していないが 制御装置に接続されていて、ディスペンサーA内と真空 40 室25内との圧力状態が管理され、所定量の液晶注入を 可能にするものである。

【0025】上記説明した図3による液晶注入の具体的 な一例を説明すると、まず、バルブV-9を開いて真空 ポンプ31により真空室25内を滅圧にするとともに液 晶セル21内をも真空引きする。同時に真空室25内に 配置されている液体用ディスペンサーAについてもバル ブV-2を開いて脱泡を行う。その後、バルブV-2を 閉じ、パルブVー3、Vー4を開いて液体用ディスペン

ター26により液体用ディスペンサーAを下降させる。 と同時にパルプV-9、V-3、V-4を閉じ、パルプ V-6、V-1を開いて液体用ディスペンサーA内に不 活性ガスを導入して液晶セル21の注入口22を細管5 から滴下する液晶で塞ぎ、その後、真空室25内を大気 圧に戻すためにV-7バルブを開いて不活性ガスを導入 することにより液晶の注入を行う。

【0026】この液晶注入は、V-1バルブを開いて液 10 体用ディスペンサーA内に不活性ガスを導入し、液体用 ディスペンサーAの細管5から液晶セル21の注入口2 2に液晶が滴下されると、この液晶の1滴の滴下を光セ ンサー34が感知してV-1バルブが閉じられ、同時に バルブV-3が開いて真空ポンプ28による液体用ディ スペンサーA内の圧力が調整された後、V-3を閉じ、 V-1バルブを開いて液体用ディスペンサーA内に不活 性ガスを送ることにより液晶の1滴の滴下が行われる、 という操作を繰り返すことにより行われる。

【0027】このようにして、真空室25内と液体用デ ィスペンサーA内の圧力差を見極めつつ液晶注入を行う この発明の液体用ディスペンサーAによれば、さきに本 出願人が提案したピストンを利用した液体用ディスペン サーに比べてディスペンサー自体の構造も簡素化されて 製造コストも低減されるので、大型セル基板に対して多 数個のディスペンサーを用いることも可能である。

【0028】なお、上記の図3においては、液晶注入口 が上部にのみ有する液晶セルに対するこの発明の液体用 ディスペンサーによる液晶注入の例を説明したが、液晶 セルへの液晶注入をさらに促進させたい場合には、図4 に示すように上下に注入口22、22aを設けた液晶セ ル21を用い、上方の注入口22からはこの発明の液体 用ディスペンサーAによる液晶の滴下注入を上記した方 法で行い、下方の注入口22aからは液晶41を充填 し、これに半ば浸るように紐状体43を設けた液晶皿4 2を真空室25内に配置し、大気圧下で下方の注入口2 2 a を紐状体43に接触させる従来の接触方式を採用す ることができる。

【0029】図5はこの発明の液晶注入方法の他の実施 例の構成を示すものであり、図4と異なるのは上下に注 入口22、22aを設けた液晶セル21、上方の注入口 22に液晶を滴下注入する液体用ディスペンサーAおよ び下方の注入口22aから液晶を注入する液晶の充填さ れた液晶皿42がそれぞれ別々の真空室25、25a、 25 bに配置されていて、真空室25が液晶注入室、2 5a、25bは脱泡室と区別されていることである。す なわち、液晶注入室となる真空室25内には上下に注入 口22、22aを設けた液晶セル21が配置されてい る。また、図4に示すと同じ構造と機能を有する液体用 ディスペンサーAは真空室25aに、液晶を充填した液 サーA内を減圧とする。このようにして真空室25内と 50 晶皿42は昇降機構44を備えた真空室25bに配置さ

れている。

【0030】そして、液体用ディスペンサーAが配置さ れている真空室25aと液晶皿が配置されている真空室 25 bは何れもゲートバルブ45で液晶セルが配置され ている真空室25に連結されている。このような構成に おいて、まず真空ポンプ31で各真空室を減圧にして脱 泡処理を行う。なお、3 1 a は液晶セルが配置されてい る真空室25の減圧をより確実にするために併用するタ ーポ分子ポンプである。次に、ゲートバルブ45を開い て液晶基板が配置されている真空室25内の液晶セルの。10 上下の注入口22、22aと一致する位置まで液体用デ ィスペンサーAおよび液晶皿42を移動させ、その後液 体用ディスペンサーAは図3に示すように上下動モータ ー26にて上方の液晶注入口22に接触させ、真空室2. 5を大気圧に戻すと同時に上記した図3の実施例と同様 の操作を行って液晶の滴下注入を行う。また下方の液晶 皿42は、昇降機構44によって下方の注入口22aに 接触させ、真空室25を大気圧に戻した時の基板内外の 圧力差と毛細管現象により液晶の注入を行うことができ るのである。

【0031】図6はさらに他の実施例を示し、図5より液晶セル21の枚数が多かったり、1つの液晶セルの上下に22、22′、22a、22a′と複数の注入口を有する場合には、液体用ディスペンサーAおよび液晶皿42を複数本(個)並列させて図5と同様の操作を行うことにより液晶注入を簡単に実施することができる。

【0032】なお、この方式は図6のような液晶セル2 1に上下の注入口を有する場合に限られるものではな く、1つの液晶セルの上方のみに注入口を有する多数の 基板や上方のみに複数の注入口を有する多数の基板に液 30 体用ディスペンサーによる液晶注入を行う場合にも実施 することができる。

【0033】また、液晶セル21に注入口として、複数の、例えば2つの注入口22、22′が設けられている場合でも、液体用ディスペンサーAの細管5の先端を図7に示すように、2つの注入口22、22′に対応するように分岐細管5aとすることによって1個のディスペンサーAで2つの注入口22、22′から同時に液晶注入を行うことができ、液晶注入作業時間の短縮をはかることができる。

【0034】さらに、液晶セル21の注入口が図8の22dで示すように、その幅が広い場合には、この注入口22dに対して使用する液体用ディスペンサーAの細管としては、注入口22dの幅と同等またはそれ以上の幅で液晶を滴下できるような細管であることが好ましく、例えば図8(a)のような三方分岐細管5b、図8

(b) のような扇状扁平管16、あるいは多孔底面または網状底面18を呈するガイド部17(図8(c))を細管5の先輩に設けることによって、注入口22d全体に亘って同時に液晶の滴下を行うことができて、常に安、50

定した液晶注入が可能となり、大型あるいは液晶注入間 隙の狭い液晶セルへの液晶注入作業時間の短縮をはかる ことができる。

【0035】図9は、それぞれに2個の注入口22、22′を設けた複数枚の液晶セル21に、分岐細管5aでしかもその先端に多孔底面を呈するガイド部17を設けた構造の細管5とした液体用ディスペンサーAを用いて液晶注入を行う態様を示したもので、これによれば2個以上の注入口を設けた大型液晶セルに液晶を注入する場合、注入口の数だけディスペンサーを用意する必要はなく、1個のディスペンサーで多数の注入口に同時に注入することが可能であり、生産効率の向上、設備費の削減に寄与するのである。

【0036】なお、複数の注入口に対して、ディスペンサーの細管の形状として上記した分岐細管、扇状扁平管あるいはどのガイド部の形状またはこれと類似した他の形状を採用するかは、液晶セルの数や注入口の大きさに応じて選択すればよい。

【0037】この他、近年、液晶セルの生産効率を挙げてコストダウンをはかるために、1枚のガラス基板に多数個の液晶セルを構成する多数個取り工法の導入が開発されつつある。そのような、例えば図10に示す2連セルや図11の6連構成のセルの場合であっても、この発明の液晶注入方法およびディスペンサーを用いることによって短時間に、しかも簡単に液晶注入を行うことができる。

【0038】上記したこの発明の液晶注入方法および液体用ディスペンサーは液晶の注入に限らず、低粘度の機能材料を数μmのような狭い間隙に注入するような技術分野においても応用が可能である。

[0039]

【発明の効果】以上説明したように、この発明の液晶注入方法は、請求項1によれば液晶のロスを最小限に止めることができて低コストで実施することができる。また請求項2および3によれば、上記の効果に加えて液晶注入時間を大幅に短縮できるとともに、精度の高い液晶注入を実現することができる。さらに請求項4乃至8に記載の液体用ディスペンサーによれば、滴下方式の液晶注入を圧力の調整制御によって高精度で行うことができ、かつ液晶セルの数や大きさに対応した使用が可能であるなど、実用上の効果は非常に大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の液体用ディスペンサーの側面図である。

【図2】 (a) ~ (c) は液体用ディスペンサーを構成する各部位の断面図である。

【図3】この発明の液晶注入方法の一実施例を示す液晶 注入装置の概念図である。

【図4】この発明の液晶注入方法の他の実施例を示す液 晶注入装置の概念図である。

12

【図 5 】この発明の液晶注入方法の他の実施例を示す液 B 液晶 晶注入装置の概念図である。

【図6】この発明の液晶注入方法の他の実施例を示す液 晶注入装置の概念図である。

【図7】液晶セルの注入口と液体用ディスペンサー細管 の形状を示す説明図である。

【図8】液晶セルの注入口と液体用ディスペンサー細管 の形状を示す説明図である。

【図9】複数の注入口を設けた複数の液晶セルに対する この発明の液体用ディスペンサによる液晶注入の態様を 10 9、10、12、14 ネジ溝 示す説明図である。

【図10】液晶セルの形状を示す説明図である。

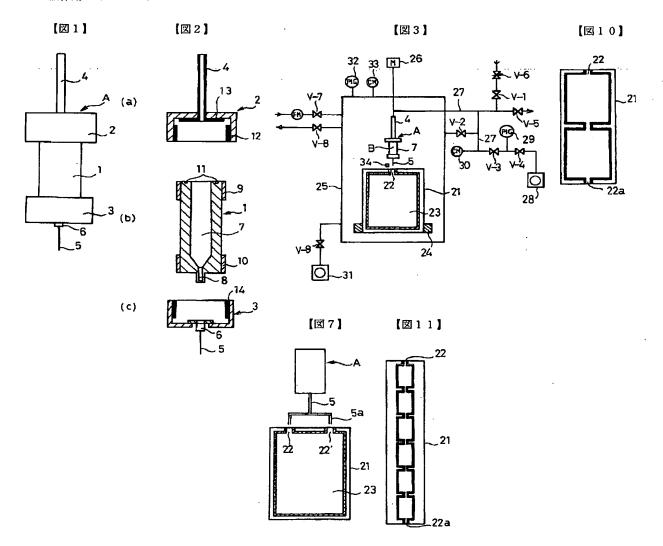
【図11】液晶セルの形状を示す説明図である。

【図12】(a)~(c)は従来の液晶注入方法を示す 説明図である。

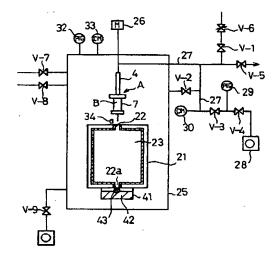
【符号の説明】

A 液体用ディスペンサー

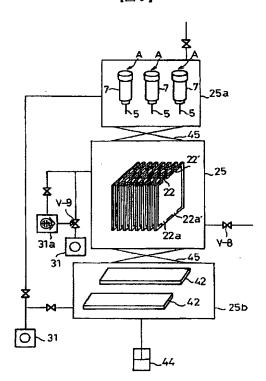
- ディスペンサー本体
- 2 上部キャップ
- 下部キャップ
- 4 不活性ガス導入管
- 5 細管
- 5 a 分岐細管
- 5 b 三方分岐細管
- 7 液溜め部
- 16 扇状扁平管
- 17 ガイド部
- 21 液晶セル
- 22、22a、22d 液晶注入口
- 25、25a、25b 真空室
- 34 光センサー



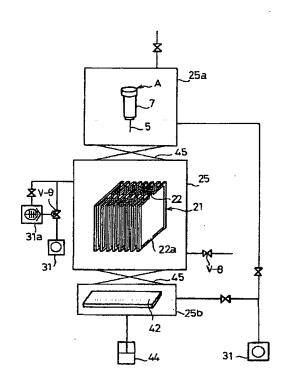


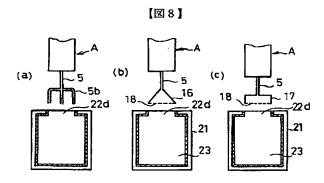


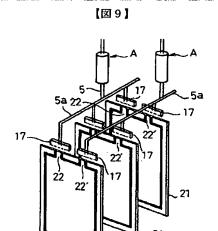
【図6】

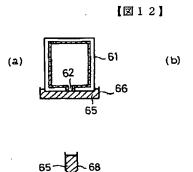


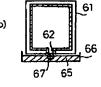
【図5】











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
\square image cut off at top, bottom or sides	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.